非接触機械試験機のための磁気浮上機構

Magnetic levitation for non-contact mechanical testing machine

# 1 緒言

磁気浮上技術は非接触という利点から,多くの産業に利 用されてきており,機械試験機にも利用されている<sup>(1)(2)(3)</sup>. 従来の機械試験機は,試験片を固定する治具と試験機の間 に働く接触力を用いて固定している.ガス中などの特殊な 環境で試験する必要がある場合,試験機全体を特殊環境内 に入れる必要がある.磁気浮上技術を利用することで,磁 性治具に非接触力を加えて,試験片に応力を与えて試験を 行える.このような装置であれば,試験片と磁性治具のみ を特殊な環境に置くことで試験が可能であり,簡便に特殊 環境下での試験が可能である.

本研究では,引張圧縮,曲げ,ねじりの磁気浮上多機能 機械試験機のための基本的考察を行ったのでこれを報告す る.

## 2 試験機の構造と動作原理

## 2.1 試験機の構造

図1は提案する試験機において浮上させる部分の磁性治 具と試験片の概略図である.図の中央に位置する赤い部分 が試験片であり、その上部に非接触で試験片を固定する磁 気浮上治具、下部に試験片に引張圧縮、曲げ、ねじりの試 験を行うための非接触応力を加えるための磁気浮上治具が 取り付けられている.上部の磁性治具はZ軸方向に永久磁 石と空芯コイルによる吸引排斥力を発生し、X、Y方向の発 生力およびZ軸周りの回転トルクは電磁石による吸引力に よって発生する.下部の治具には電磁石による吸引力のみ を用いて応力を発生させる.



Fig. 1 Overview of magnetic levitation test machine

# 2.2 引張, 圧縮試験の動作原理とハルバッハ配列の利用

今回の発表では、図1に示す浮上治具のうち上部の治具 について設計,開発を行った.図2に提案する引張圧縮, システム工学群

### 機械・航空システム制御研究室 1240080 鈴木 健範

曲げ,ねじりの機械試験機に利用可能な上部の治具の磁気 浮上機構の全体図と磁性治具の断面図を示す.試験片は図1 のように上下方向に配置され引張圧縮試験は鉛直方向(Z方 向)の応力を加えることで試験される.図3にZ方向の動作 原理を示す.図3のように空芯コイルと永久磁石による吸 引排斥力を利用することで引張圧縮試験が可能な機構とす る.圧縮試験も行える試験機を製作するため,吸引力しか ない電磁石だけでは応力発生のためには不十分である.圧 縮試験を行うためには鉛直下向き方向への力が必要である が、上部の治具の下部には試験片を設置するため、上部の 治具の下部に電磁石を設置することはできない.

空芯コイルによるローレンツ力を用いる機構を提案す る.しかし、空芯コイルは電磁石よりも、試験するために 大きな電流が必要となる.コイルの銅線には流すことので きる電流の大きさに限界があるため、磁極の向きが異なる 永久磁石を組み合わせたハルバッハ配列(4)の永久磁石を利 用する.ハルバッハ配列とは、複数の永久磁石を組み合わ せることによって特定の方向の磁場強度を大きくする技術 である.図4にコイルの巻き数を562turns、空芯コイルと永 久磁石のエアギャップを3.5mmとし、ハルバッハ配列永久 磁石を利用しているときと磁極が一方向のみの永久磁石を 利用しているときと空芯コイルに流れる電流に対する浮上 力の大きさを比較したグラフを示す.図4からハルバッハ 配列を利用することで、同じ電流の大きさでもより大きな Z方向の発生力が得られることがわかる.



Fig. 2 Overview of suggested mechanism and cross-sectional view of the floating object



Fig. 3 Working Principle of Z



#### 2.3 曲げ、ねじり試験の動作原理

図5左にX,Y方向と図5右にZ軸周りの回転の動作原 理を示す.曲げ試験を行うときに下部の治具に-X方向に非 接触応力が加わるため、上部の治具にX方向の吸引力を発 生するように電磁石を図5左のように配置している.ねじ りの試験を行うときに下部の治具からZ軸に右ねじのトル クが加えられるため、上部の治具が固定を保持するために 図5右のように反対方向にトルクが発生するように電磁石 をそれぞれの面の中心から少しずらして配置している.



Fig. 5 Working Principle of X, Y and RZ

### 3 シミュレーション

引張, 圧縮試験で,下部の治具から Z 方向に負荷が加え られたときの,空芯コイルと永久磁石のエアギャップzを空 芯コイルの電流iで制御し,安定させることが目的である. 浮上物体の質量をmとするときのプラントモデルを以下と する.

$$\frac{\Delta z}{\Delta i} = \frac{k_i}{-ms^2} \tag{1}$$

ただし、 $k_i$ は空芯コイルと永久磁石の動的パラメータに依存する係数である. 平衡状態 $F_0(i_0,z_0)$ を $i_0 = \frac{mg}{k_i}$ (A),  $z_0 =$ 

0.5(mm)と定義し, PD 制御器を用いてエアギャップzの位置 制御のシミュレーションを行う.1 秒後に Z 方向に 0.3mm のステップ外乱を与え,そのときに設定したパラメータを 表1,結果を図6に示す.

Table 1 Simulation parameters of Z

m(kg)	$z_0(\text{mm})$	P(A/m)	D(As/m)	$k_i(N/A)$
0.674	0.5	373.4	12.2	3.3



図6より、1秒にステップ外乱を加えたとき、定常値に収束 する整定時間が0.1(s)であるのに対してステップ外乱に対す るオーバーシュートが5%以内であるため、Z方向の変位z の安定性を維持するには十分な結果であるといえる.X,Y 方向の並進とZ軸周りの回転に関しても同様にシミュレー ションを行い、それぞれゲインなどのパラメータを得た.

#### 4 試験機の製作

図7に製作した試験機を示す.そして、図8に製作した ハルバッハ配列の永久磁石を示す. 試験機に変位センサを4 つ設置し、シミュレーションから得られたパラメータをも とに浮上実験を検討する.



## 5 結言

提案した多機能機械試験の機構の制御シミュレーション を行い,試験機を製作した.

試験機を動作させてシミュレーション結果のような応答が 得られるような制御,試験片に負荷を加える側の磁気浮上 の機構について検討する.

#### 文献

- Ren, Mengyi, and Koichi Oka. "Design and analysis of a non-contact tension testing device based on magnetic levitation." *IEEE Access* 10 (2022): 19312-19332.
- (2) Ren, Mengyi, and Koichi Oka. "Design of a Non-contact Bending Testing Device using Magnetic Levitation Mechanism." *IEEE Transactions on Industrial Electronics* (2023).
- (3) Ren, Mengyi, and Koichi Oka. "Design of a Noncontact Torsion Testing Device Using Magnetic Levitation Mechanism." Actuators. Vol. 12. No. 4. MDPI, 2023.
- (4)大洋電機エンジニアリング

https://taiyo-denki.com/product-h/